

国際会議「第 14 回スパッタリングおよびプラズマプロセスに関する国際シンポジウム」

日程:2017 年 7 月 5 日～7 日

主催:一般社団法人 日本真空学会

AVS

協賛・後援:原子衝突学会

一般社団法人 電子情報通信学会

日本真空工業会

場所:金沢工業大学 扇が丘キャンパス 12 号館 アントレプレナーズラボ

参加費:2017 年 6 月 2 日まで

主催団体会員 35,000 円、原子衝突学会会員 47,000 円、一般 50,000 円

期日以降

主催団体会員 40,000 円、原子衝突学会会員 52,000 円、一般 55,000 円

内容:このシンポジウムは隔年で開催しており、気体イオンの原子とターゲット原子の衝突現象を利用するスパッタリング及びプラズマプロセス技術を主題としております。135 件以上のプレゼンテーションがあり、210 以上の方に参加頂いております。本シンポジウムの大きな特長として、招待講演者を含む全ての口頭発表講演者にもポスター発表を依頼し、参加者に口頭発表時だけでなく十分な時間質問する機会を提供しております。また、若手研究者を奨励する目的で 3 件のポスター賞を授与しております

連絡先:東金沢工業大学 高度材料科学研究開発センター内 ISSP2017 事務局

(担当) 堀 則子 TEL :076-274-9250 e-mail:sec@issp2017.jp

<http://issp2017.jp>

をご覧ください。